## エピタキシャル $Ni_xFe_{4-x}N(x=0,1,3,4)$ 薄膜の磁気物性の評価

伊藤啓太 <sup>1,2,3</sup>, 鹿原和樹 <sup>2</sup>, 高田郁弥 <sup>1</sup>, 東小薗創真 <sup>1</sup>, 具志俊希 <sup>1</sup>, 都甲薫 <sup>1</sup>, 角田匡清 <sup>2</sup>, 末益崇 <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> 筑波大数理物質, <sup>2</sup> 東北大工, <sup>3</sup> 日本学術振興会 PD)

Magnetic properties of epitaxially grown  $Ni_xFe_{4-x}N(x = 0, 1, 3, and 4)$  films K. Ito<sup>1,2,3</sup>, K. Kabara<sup>2</sup>, F. Takata<sup>1</sup>, S. Higashikozono<sup>1</sup>, T. Gushi<sup>1</sup>, K. Toko<sup>1</sup>, M. Tsunoda<sup>2</sup>, and T. Suemasu<sup>1</sup> (<sup>1</sup>Inst. of Appl. Phys., Univ. of Tsukuba, <sup>2</sup>Dept. of Electronic Eng., Tohoku Univ., <sup>3</sup>JSPS-PD)

## はじめに

逆ペロブスカイト型遷移金属強磁性窒化物は、高い負のスピン分極率( $Fe_4N$ )や垂直磁気異方性( $Mn_4N$ )により、スピントロニクス応用材料として注目されている  $^1$ )。類型材料の  $Ni_xFe_{4-x}N$  は、粉末試料では Ni 添加量に伴って飽和磁化( $M_8$ )ならびにキュリー温度( $T_C$ )が低下し、 $x \ge 3$ では  $T_C$ が室温を下回ると報告されている  $^2$ 0。一方で、反応性スパッタ法で作製された  $Ni_3FeN$  では、室温で 6%の大きな正の異方性磁気抵抗(AMR)効果が報告されており  $^3$ 0、その物性が十分に明確化されていない。本研究では、分子線エピタキシー(MBE)法により  $Ni_xFe_{4-x}N$  薄膜をエピタキシャル成長し、磁化曲線と AMR 効果を評価することで、上記磁気物性を検証した。

## 実験方法

固体 Fe, Ni と高周波プラズマ  $N_2$  の同時供給による MBE 法により、 $SrTiO_3(001)$  基板上に  $Ni_xFe_{4-x}N(x=0,1,3,4)$  薄膜(50 nm)をエピタキシャル成長し、磁化曲線を測定した。得られた  $M_S$  を第一原理計算から求めた値と比較した。 $NiFe_3N$  および  $Ni_3FeN$  薄膜については、[100] が長手方向の幅 0.2 mm のホールバー形状に加工し、測定温度(T)5~300 K の範囲で、外部磁場 30 kOe、直流電流 0.2 mA のもとで AMR 効果を測定した。

## 実験結果

Fig. 1 に、第一原理計算、室温および 2 K における磁化曲線から求めた  $Ni_xFe_{4-x}N(x=0,1,3,4)$ 薄膜の  $M_s$  を示す。第一原理計算では  $Ni_xFe_{4-x}N$  は強磁性を示し、Ni 比が増えるに従い  $M_s$  は単調に減少し、実験でも同様の傾向が得られた。しかし、室温において  $Ni_3FeN$  の磁化は消失し、 $Ni_4N$  に関しては 2 K でも常磁性を示した。M-T 測定から  $Ni_3FeN$  の  $T_C$  は 266 K と見積もられ、Ref. 2 の結果を支持するものとなった。 Fig. 2 に  $NiFe_3N$  および  $Ni_3FeN$  の AMR 比の T 依存性を示す。  $Ni_3FeN$  の室温における AMR 比はほぼ 0 であり、 Ref. 3 の結果とは異なった。また、双方の試料で低温領域にて負の AMR 効果が観測された。 Rotation Rotation

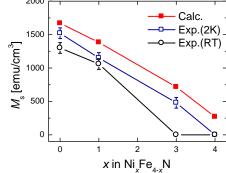
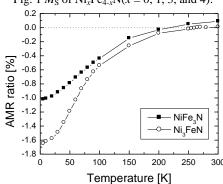


Fig. 1  $M_S$  of Ni<sub>x</sub>Fe<sub>4-x</sub>N(x = 0, 1, 3, and 4).



ついても、 $Fe_4N$  と同様に少数スピン伝導が優勢といえる。 Fig. 2 T versus AMR ratio of  $Ni_xFe_{4x}N$  (x=1 and 3). **謝辞** 本研究は JSPS 科研費(Nos. 26249037 and 14J01804)、東北大通研プロ(H26/A04)の支援を受けた。磁化測定は、筑波大学 喜多・柳原・Sharmin 研究室および研究基盤総合センター低温部門のご協力で行った。

<u>参考文献</u> 1) 角田ら, まぐね **11**, 125 (2016). 2) X. G. Diao *et al.*, J. Appl. Phys. **85**, 4485 (1999). 3) R. Loloee, J. Appl. Phys. **112**, 023902 (2012). 4) S. Kokado and M. Tsunoda, J. Phys. Soc. Jpn. **84**, 094710 (2015).